強磁性トンネル接合における電圧誘起磁気キャパシタンス効果

海住英生、三澤貴浩、長浜太郎*、小峰啓史**、北上 修***、 藤岡正弥、西井準治、Gang Xiao**** (北大電子研、*北大工、**茨大工、***東北大多元研、****ブラウン大学) Voltage-induced Magnetocapacitance Effect in Magnetic Tunnel Junctions H. Kaiju, T. Misawa, T. Nagahama*, T. Komine**, O. Kitakami***, M. Fujioka, J. Nishii and G. Xiao**** (Hokkaido Univ. RIES, *Hokkaido Univ. Eng., **Ibaraki Univ. Eng., ***Tohoku Univ. IMRAM, ****Brown Univ. Rhys.)

<u>はじめに</u>

近年、強磁性トンネル接合 (MTJ) におけるトンネル磁気キャパシタンス (TMC) 効果は、静的なスピン蓄積 や動的なスピンダイナミクスに関する新たな学術的知見を与える一方、高感度磁気センサや磁気メモリへの 応用も期待されていることから国内外で大きな注目を集めている[1-4]。 TMC 効果の興味深い特徴の一つとし て、電圧に対するロバスト性が挙げられる。例えば、TMC の V₁₂ (=ゼロバイアス付近の TMC 比が半分にな るときの電圧) はトンネル磁気抵抗 (TMR) と比較して 2 倍程度大きいことが報告されている[5]。このような ロバスト性に関連して、本研究では、電圧に対して TMC が増大する新しい現象を見出したので報告する。

<u>実験方法</u>

超高真空マグネトロンスパッタ装置を用いて、熱酸化 Si 基板上 に Ta/Co₅₀Fe₅₀/IrMn/Co₅₀Fe₅₀/Ru/Co₄₀Fe₄₀B₂₀/MgO/Co₄₀Fe₄₀B₂₀/Ta/Ru から構成される MTJ を作製した。強磁性層 Co₄₀Fe₄₀B₂₀の膜厚は 3 nm、絶縁層 MgO の膜厚は 2 nm とした。微細加工にはフォトリソ グラフィーとイオンミリング法を用いた。接合面積は 1800 μm² とした。TMC および TMR 効果の測定には、室温磁場中交流 4 端 子法を用いた。

<u>実験結果</u>

図1にTMRとTMCのバイアス依存性を示す。TMR比はバイ アス電圧の上昇とともに減少することがわかる。一方、TMC比に ついては低バイアスにおいてやや減少するが、高バイアスでは増 大する興味深い現象が観測された。これらの実験結果を説明する ため、理論計算による解析を行った。TMRの計算には Zhang モデ ルを用いた[6]。TMCの計算には4次関数バリア近似(QBA)とス ピン依存ドリフト拡散(SDD)モデル[2]を取り入れた Debye-Fröhlichモデルを用いた。その結果、図2に示すように、実験結 果と計算結果が良い一致を示すことがわかった。これはスピンキ ャパシタンスが電圧誘起 TMC 効果に大きな影響を及ぼすことを 意味する。講演ではより詳細な実験・計算結果について報告する。



図 1: (a) TMR と(b)TMC のバイアス電圧 依存性



<u>参考文献</u>

[1] H. Kaiju et al.: Appl. Phys. Lett. 107, 132405 (2015). [2] T.-H. Lee et al.: Sci. Rep. 5, 13704 (2015).

- [3] S. Parui et al.: Appl. Phys. Lett. 109, 052401 (2016). [4] H. Kaiju et al.: Sci. Rep. 7, 2682 (2017).
- [5] A. M. Sahadevan et al.: Appl. Phys. Lett. 101, 162404 (2012). [6] S. Zhang et al.: Phys. Rev. Lett. 79, 3744 (1997).